# (19)日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号 特開2001-223885 (P2001-223885A)

(43)公開日 平成13年8月17日(2001.8.17)

(51) Int.CL'		識別記号	ΡI	ΡI		テーマコード( <del>多考</del> )	
H04N	1/387		H04N	1/387		5B057	
G06T	1/00	500	GO6T	1/00	500B	5 C O 7 6	
H04N	1/40		H04N	1/40	Z	5 C O 7 7	

## 審査請求 未請求 請求項の数23 OL (全 20 頁)

(21)出願番号	特質2000-287599(P2000-287599)	(71)出顧人	000001007
(22)出顧日	平成12年9月21日(2000.9.21)	(72)発明者	キヤノン株式会社 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 宮下 朋之
(31) 優先権主張番号 (32) 優先日	特顧平11-338236 平成11年11月29日(1999.11.29)	(10/)1977	東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤノン株式会社内
(33)優先權主張國	日本 (JP)	(74)代理人	100076428 弁理士 大塚 康徳 (外2名)

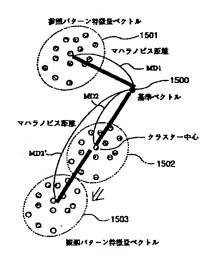
最終頁に続く

# (54) 【発明の名称】 画像処理装置及びその方法とその記憶媒体

## (57)【要約】

【課題】 画像の劣化を無くして、その画像にアクセス 制御情報を埋め込み、また埋め込まれているアクセス制 御情報を高精度に読み取る。

【解決手段】 参照パターンと基準ベクトルとの第1マハラノビス距離と、対象2値画像のパターンの特徴量と基準ベクトルとの第2マハラノビス距離とを比較し、その比較した比較結果と、対象2値画像に埋め込むアクセス制御情報とに応じて、その対象2値画像の特徴量ベクトル空間1502を1503に平行移動し、その特徴量ベクトル空間を平行移動した結果に基づいて、対象2値画像を変更して画像を形成する。



# 【特許請求の範囲】

【請求項1】 2値画像を入力して処理する画像処理装置であって、

1

対象2値画像の特徴量空間と基準ベクトルとの第1マハラノビス距離を求める演算手段と、

前記対象2値画像の前記マハラノビス距離と、前記参照 パターンの特徴量空間と基準ベクトルとの間の第2マハラノビス距離とを比較する比較手段と、

前記比較手段により比較された比較結果と、前記対象2 値画像に埋め込むアクセス制御情報とに応じて前記対象 10 2値画像の特徴量ベクトル空間を平行移動する平行移動 手段と、

前記特徴量ベクトル空間を平行移動した結果に基づい て、前記対象2値画像を変更する変更手段と、を有する ことを特徴とする画像処理装置。

【請求項2】 前記対象2値画像と基準ベクトルとの第 1マハラノビス距離は、下式により求められ、

D2= (x-μ)'Σ<sup>-1</sup> (x-μ) ····式 (1) ここで、xは基準ベクトル、μは参照パターン特徴量空間の平均ベクトル、Σ<sup>-1</sup>は、参照パターン特徴量空間の 20 分散共分散行列の逆行列、そして、D2は基準ベクトル xと参照パターン特徴量空間の平均ベクトルμのマハラノビス距離であることを特徴とする請求項1に記載の画像処理装置。

【請求項3】 前記平行移動手段は、前記対象2値画像 の特徴量ベクトルの各要素の値が増える方向に移動する ことを特徴とする請求項1に記載の画像処理装置。

【請求項4】 前記参照パターンの特徴量空間と基準ペクトルとの間の第2マハラノビス距離は、下式により求められ、

 $D2 = (x-\mu)^{\pi} \Sigma^{-1} (x-\mu)$ 

ここで、xは基準ベクトル、μは観測パターン特徴量空間の平均ベクトル、Σ-1は、観測パターン特徴量空間の分散共分散行列の逆行列、そして、D2は基準ベクトル xと観測パターン特徴量空間の平均ベクトルμのマハラノビス距離であることを特徴とする請求項1に記載の画像処理装置。

【請求項5】 前記パターン特徴量空間は、前記対象2 像に 値画像の輪郭画像に各画素において、当該画素の周辺画 画像 素が存在しているか否かを示すベクトル情報の集合であ 40 と、 ることを特徴とする請求項1に記載の画像処理装置。 前記

【請求項6】 前記平行移動手段は、前記アクセス制御情報の値が0の時は、前記第1マハラノビス距離が前記第2マハラノビス距離よりも所定量大きくなるように移動し、前記アクセス制御情報の値が1の時は、前記第1マハラノビス距離が前記第2マハラノビス距離と前記所\*

 $D2 = (x - \mu)' \Sigma^{-1} (x - \mu)$ 

ここで、xは基準ベクトル、 $\mu$ は参照パターン特徴量空 %xと参照パター間の平均ベクトル、 $\Sigma^{-1}$ は、参照パターン特徴量空間の ノビス距離であか散共分散行列の逆行列、そして、D2は基準ベクトル %50 画像処理方法。

\*定量との和よりも小さくなるように移動することを特徴とする請求項1に記載の画像処理装置。

【請求項7】 前記変更手段により変更された前記対象 2値画像に対応する画像データに基づいて印刷する印刷 手段を更に有することを特徴とする請求項1に記載の画 像処理装置。

【請求項8】 前記変更手段により変更された前記対象 2値画像に基づいて形成された原稿画像を読み取って、 当該画像の輪郭部を抽出する抽出手段と、

前記輪郭部に対応する画像のパターン特徴量空間と基準ベクトルとの間のマハラノビス距離を求める距離演算手段と、

前記距離演算手段により求められた前記マハラノビス距離と前記第1マハラノビス距離とに応じて、前記原稿画像に埋め込まれている前記アクセス制御情報を検出する検出手段と、を更に有することを特徴とする請求項1に記載の画像処理装置。

【請求項9】 原稿画像を読み取って、画像の輪郭部を抽出する抽出手段と、

前記輪郭部に対応する画像の特徴量空間と基準ベクトルとの第1マハラノビス距離を求める第1距離算出手段と、

参照パターンの特徴量空間と基準ベクトルとの第2マハラノビス距離を求める第2距離算出手段と、

前記第1及び第2マハラノビス距離の差分を求める差分。 演算手段と、

前記差分演算手段により求められた前記差分に応じて、 前記原稿画像に埋め込まれている制御情報を検出する検 出手段と、を有することを特徴とする画像処理装置。

30 【請求項10】 2値画像を入力して処理する画像処理 方法であって、

対象2値画像の特徴量空間と基準ベクトルとの第1マハラノビス距離を求める演算工程と

前記対象2値画像の前記マハラノビス距離と、前記参照 パターンの特徴量空間と基準ベクトルとの間の第2マハラノビス距離とを比較する比較工程と、

前記比較工程で比較された比較結果と、前記対象2値画像に埋め込むアクセス制御情報とに応じて前記対象2値 画像の特徴量ベクトル空間を平行移動する平行移動工程 と

前記特徴量ベクトル空間を平行移動した結果に基づいて、前記対象2値画像を変更する変更工程と、を有することを特徴とする画像処理方法。

【請求項11】 前記対象2値画像と基準ベクトルとの 第1マハラノビス距離は、下式により求められ、

### …式(1)

※xと参照バターン特徴量空間の平均ベクトルμのマハラ ノビス距離であることを特徴とする請求項10に記載の ) 画像処理方法。 【請求項12】 前記平行移動工程では、前記対象2値 画像の特徴量ベクトルの各要素の値が増える方向に移動 することを特徴とする請求項10に記載の画像処理方 法。

【請求項13】 前記参照パターンの特徴量空間と基準 ベクトルとの間の第2マハラノビス距離は、下式により 求められ、

 $D2 = (x-\mu)^{n} \Sigma^{-1} (x-\mu)$ 

ここで、xは基準ベクトル、μは観測パターン特徴量空間の平均ベクトル、Σ<sup>-1</sup>は、観測パターン特徴量空間の 10 分散共分散行列の逆行列、そして、D2は基準ベクトル xと観測パターン特徴量空間の平均ベクトルμのマハラノビス距離であることを特徴とする請求項10に記載の 画像処理方法。

【請求項14】 前記パターン特徴量空間は、前記対象 2値画像の輪郭画像に各画素において、当該画素の周辺 画素が存在しているか否かを示すベクトル情報の集合で あることを特徴とする請求項10に記載の画像処理方 法。

【請求項15】 前記平行移動工程では、前記アクセス 20 制御情報の値が0の時は、前記第1マハラノビス距離が前記第2マハラノビス距離よりも所定量大きくなるように移動し、前記アクセス制御情報の値が1の時は、前記第1マハラノビス距離が前記第2マハラノビス距離と前記所定量との和よりも小さくなるように移動することを特徴とする請求項10に記載の画像処理方法。

【請求項16】 前記変更工程で変更された前記対象2 値画像に対応する画像データに基づいて印刷する印刷工程を更に有することを特徴とする請求項10に記載の画像処理方法。

【請求項17】 前記変更工程で変更された前記対象2 値画像に基づいて形成された原稿画像を読み取って、当 該画像の輪郭部を抽出する抽出工程と、

前記輪郭部に対応する画像のパターン特徴量空間と基準 ベクトルとの間のマハラノビス距離を求める距離演算工 程と、

前記距離演算工程で求められた前記マハラノビス距離と前記第1マハラノビス距離とに応じて、前記原稿画像に埋め込まれている前記アクセス制御情報を検出する検出工程と、を更に有することを特徴とする請求項10に記 40載の画像処理方法。

【請求項18】 原稿画像を読み取って、画像の輪郭部を抽出する抽出工程と、

前記輪郭部に対応する画像の特徴量空間と基準ベクトル との第1マハラノビス距離を求める第1距離算出工程 と、

参照パターンの特徴量空間と基準ベクトルとの第2マハラノビス距離を求める第2距離算出工程と、

前記第1及び第2マハラノビス距離の差分を求める差分 演算工程と、 前記差分演算工程で求められた前記差分に応じて、前記 原稿画像に埋め込まれている制御情報を検出する検出工 程と、を有することを特徴とする画像処理方法。

【請求項19】 画像を入力する画像入力手段と、

前記画像入力手段により入力した画像の輪郭を抽出する抽出手段と、

前記抽出手段により抽出された輪郭を構成する各画素について、その周辺画素の状態に応じたベクトル情報を生成するベクトル生成手段と、

前記ベクトル情報に基づいて、透かし情報に応じて前記 画像を変更して前記透かし情報を埋め込む埋め込み手段 と、を有することを特徴とする画像処理装置。

【請求項20】 前記ベクトル情報は、注目画素の周辺 8画素が存在しているか否かを示す8次元のベクトル情報であることを特徴とする請求項19に記載の画像処理 装置

【請求項21】 画像を入力する画像入力工程と、前記画像入力工程で入力した画像の輪郭を抽出する抽出工程と、

的 前記抽出工程で抽出された輪郭を構成する各画素について、その周辺画素の状態に応じたベクトル情報を生成するベクトル生成工程と、

前記ベクトル情報に基づいて、透かし情報に応じて前記 画像を変更して前記透かし情報を埋め込む埋め込み工程 と、を有することを特徴とする画像処理方法。

【請求項22】 前記ベクトル情報は、注目画素の周辺 8画素が存在しているか否かを示す8次元のベクトル情報であることを特徴とする請求項21に記載の画像処理 方法。

30 【請求項23】 請求項10乃至18及び21、22の いずれか1項に記載の画像処理方法を実行する制御プロ グラムを記憶した、コンピュータにより読取り可能な記 憶媒体。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、文書画像等に透かし情報であるアクセス制御情報を埋め込む画像処理装置 及びその方法とその記憶媒体に関するものである。

[0002]

40 【従来の技術】近年、プリンタ、複写機等のデジタル画像形成装置において形成される画質は著しく向上してきており、これらの装置を使用して、容易に高画質の画像が印刷できるようになってきている。更に、高性能スキャナ、プリンタ、複写機の低価格化、及びコンピュータによる画像処理等により、誰でも容易に希望する印刷物を得ることができるようになってきている。そのため、文書や画像、写真等の印刷物(以下、単に印刷物とする)の不正コピーなどの問題が発生してきている。従って、その様な不正コピーによる印刷物の無断使用を防止50 或は抑止するために、その印刷物に透かし情報であるア

クセス制御情報を埋め込むことが行われている。

5

【0003】このようなアクセス制御機能としては、印 刷物にアクセス制御情報を目に見えないように埋め込む もの、文書の余白にアクセス制御情報に対応したビット マップパターン (グリフコード、DDコードなど) を埋 め込むもの、文書画像にスクランブル暗号をかけるもの 等が一般的である。そのうち、アクセス制御情報を目に 見えないように埋め込むものとしては、一般的な実現方 法として、英文字列のスペースの量をコントロールする 転させその回転量に応じてアクセス制御情報を埋め込む もの、更には文字を拡大、縮小させて、その拡大率、縮 小率に応じてアクセス制御情報を埋め込むもの等があ る.

【0004】図21は、英文字列の単語間のスペース量 を制御することにより、アクセス制御情報を埋め込む例 を説明する図である。ここで1701は単語間のスペー スを示しており、このスペースは、埋め込む透かしビッ トが "0" ならば、 $p\leftarrow (1+p) (p+s)/s$  s ← (1-p) (p+s)/2とし、透かしビットが "1" ならば、p←(1-p) (p+s)/2 s← (1+p) (p+s)とする。

【0005】図22及び図23は、文字を回転させて、 その回転量に応じてアクセス制御情報を埋め込む例を示 す図である。ここで、図22は、文字を回転させる前の 状態を示し、図23は、文字を回転させた後の状態を示 している。1901は、文字の回転角度 $\theta$ を示す。

【0006】図24は、文字を拡大/縮小させてアクセ ス制御情報を埋め込む例を示す図で、2001は元の文 字幅を示し、2002は、縮小後の文字幅を示してお り、このような拡大/縮小に応じて、アクセス制御情報 が埋め込まれる。

#### [0007]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、このよ うなアクセス制御情報の埋め込み方法によれば、元の文 字や画像が明らかに変形されたものとなってしまい、元 の文字や画像の劣化を招くことになる。

【0008】また、このようなアクセス制御情報の埋め 込み方法によれば、埋め込まれているアクセス制御情報 を正確に検出するために、印刷物を高精度に読み取っ て、かつ、例えば単語間のスペース量、文字の回転角、 文字のサイズを正確に読み取る必要がある。そのため、 小さい文字サイズで、かつ高解像度で印刷を行うと、そ の印刷された印刷物に埋め込まれているアクセス制御情 報を検出するのは非常に困難になるという問題がある。

【0009】本発明は上記従来例に鑑みてなされたもの で、画像の劣化を無くして、その画像にアクセス制御情 報を埋め込むことができる画像処理装置及びその方法と その記憶媒体を提供することを目的とする。

【0010】又本発明の目的は、埋め込まれているアク

セス制御情報を高精度に読み取ることができる画像処理 装置及びその方法とその記憶媒体を提供することにあ

## [0011]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため に本発明の画像処理装置は以下のような構成を備える。 即ち、2値画像を入力して処理する画像処理装置であっ て、対象2値画像の特徴量空間と基準ベクトルとの第1 マハラノビス距離を求める演算手段と、前記対象2値画 ことによりアクセス制御情報を埋め込むもの、文字を回 10 像の前記マハラノビス距離と、前記参照パターンの特徴 量空間と基準ベクトルとの間の第2マハラノビス距離と を比較する比較手段と、前記比較手段により比較された 比較結果と、前記対象 2 値画像に埋め込むアクセス制御 情報とに応じて前記対象2値画像の特徴量ベクトル空間 を平行移動する平行移動手段と、前記特徴量ベクトル空 間を平行移動した結果に基づいて、前記対象2値画像を 変更する変更手段とを有することを特徴とする。

> 【0012】上記目的を達成するために本発明の画像処 理装置は以下のような構成を備える。即ち、原稿画像を 20 読み取って、画像の輪郭部を抽出する抽出手段と、前記 輪郭部に対応する画像の特徴量空間と基準ベクトルとの 第1マハラノビス距離を求める第1距離算出手段と、参 照パターンの特徴量空間と基準ベクトルとの第2マハラ ノビス距離を求める第2距離算出手段と、前記第1及び 第2マハラノビス距離の差分を求める差分演算手段と、 前記差分演算手段により求められた前記差分に応じて、 前記原稿画像に埋め込まれている制御情報を検出する検 出手段とを有することを特徴とする。

> 【0013】上記目的を達成するために本発明の画像処 30 理装置は以下のような構成を備える。即ち、画像を入力 する画像入力手段と、前記画像入力手段により入力した 画像の輪郭を抽出する抽出手段と、前記抽出手段により 抽出された輪郭を構成する各画素について、その周辺画 素の状態に応じたベクトル情報を生成するベクトル生成 手段と、前記ベクトル情報に基づいて、透かし情報に応 じて前記画像を変更して前記透かし情報を埋め込む埋め 込み手段と、を有することを特徴とする。

> 【0014】上記目的を達成するために本発明の画像処 理方法は以下のような工程を備える。即ち、2値画像を 40 入力して処理する画像処理方法であって、対象2値画像 の特徴量空間と基準ベクトルとの第1マハラノビス距離 を求める演算工程と、前記対象2値画像の前記マハラノ ビス距離と、前記参照パターンの特徴量空間と基準ベク トルとの間の第2マハラノビス距離とを比較する比較工 程と、前記比較工程で比較された比較結果と、前記対象 2値画像に埋め込むアクセス制御情報とに応じて前記対 象2値画像の特徴量ベクトル空間を平行移動する平行移 動工程と、前記特徴量ベクトル空間を平行移動した結果 に基づいて、前記対象 2 値画像を変更する変更工程とを 50 有することを特徴とする。

R

【0015】上記目的を達成するために本発明の画像処理方法は以下のような工程を備える。即ち、原稿画像を読み取って、画像の輪郭部を抽出する抽出工程と、前記輪郭部に対応する画像の特徴量空間と基準ベクトルとの第1マハラノビス距離を求める第1距離算出工程と、参照パターンの特徴量空間と基準ベクトルとの第2マハラノビス距離を求める第2距離算出工程と、前記第1及び第2マハラノビス距離の差分を求める差分演算工程と、前記差分演算工程で求められた前記差分に応じて、前記原稿画像に埋め込まれている制御情報を検出する検出工 10程とを有することを特徴とする。

【0016】上記目的を達成するために本発明の画像処理方法は以下のような工程を備える。即ち、画像を入力する画像入力工程と、前記画像入力工程で入力した画像の輪郭を抽出する抽出工程と、前記抽出工程で抽出された輪郭を構成する各画素について、その周辺画素の状態に応じたベクトル情報を生成するベクトル生成工程と、前記ベクトル情報に基づいて、透かし情報に応じて前記画像を変更して前記透かし情報を埋め込む埋め込み工程と、を有することを特徴とする。

#### [0017]

【発明の実施の形態】以下、添付図面を参照して本発明の好適な実施の形態を詳細に説明する。なお、以下の実施の形態では、特にモノクロのレーザビーム・プリンタ(以下、モノクロLBPとする)を例にとり説明する。【0018】文書画像は、2値の白黒画像とし、更に、印刷物を読み取る画像読み取り装置には低価格のスキャナを用いる。

【0019】[実施の形態1]図1は、本発明の実施の 形態1のアクセス制御情報の埋め込みに係わるモノクロ 30 LBPの文書画像データの変換の流れを示す図である。 この図では、文書の画像データが2値の画像データ10 1としてモノクロLBPのプリンタドライバに渡される。次に、2値の画像データ101は、各プリンタの特性に合ったデバイスの2値データ102に変換され、更に、デバイスの2値データ102は多値K画像データ103に分解され、多値K画像データ103は2値K画像データ104に2値化される。

【0020】この2値K画像データ104がプリンタエンジンに渡され、紙等に高解像度で印刷される。

【0021】図2は、本発明の実施の形態1に係わるスキャナによるアクセス制御情報の読み取りに係わる画像データの変換の流れを示す図である。この図では、読み取られた文書の画像データが多値のグレースケールの画像データ201として、スキャナドライバに渡される。【0022】次に、本実施の形態1に係わる観測パターン特徴量空間、基準ベクトル、参照パターン特徴量空間について述べる。

\*【0023】図3は、2値のK画像データ104の一部 に相当するM×N画素の画像例を示す図である。

【0024】図4は、図3の画像の輪郭部を抽出して1 画素に細線化した輪郭画像を示す図である。

【0025】図5は、注目画素を3×3画素ブロックの中心に置いた場合、その注日画素の特徴量を抽出するための方向指数指標を示す図である。この図では、注目画素のt1, t2, t3, t8方向に画素があり、t4, t5, t6, t7方向に画素がない場合を示している。

0 【0026】図6は、図5の注目画素の方向指数の特徴 量t1, t2, t3, t4, t5, t6, t7, t8に対する値 を示す。ここで、"1"はその方向に画素があることを 示し、"0"はその方向に画素が無いことを示す。

【0027】図7は、図6に示した図5の注目画紫Pijの方向指数特徴量をベクトル化したものである。

【0028】ここで、方向指数特徴量ベクトルHijは、 注目画素Pijの方向指数特徴量のベクトルを示す。また、このベクトルの次元数は8次元とする。

【0029】観測パターン特徴量空間は、図4で得られ 20 た輪郭画像における各画素毎の方向指数特徴量ベクトル の集合である。また、観測パターン特徴量空間の次元数 は、8次元とする。

【0030】図8は、基準ベクトルパターンを示し、この基準ベクトルパターンの基準ベクトルはパターンの方向指数特徴量とし、図9は、この方向指数特徴量を示すベクトルDISTを示している。このベクトルの次元数は8次元とする。

【0031】図10は、S×T画素の参照画像の一例を示す図で、図11はその輪郭画像を示し、参照パターン特徴量空間は、この輪郭画像における各画素毎の方向指数特敵量ベクトルの集合である。また、参照パターン特徴量空間の次元数は8次元とする。

【0032】次に、文書画像にアクセス制御情報を埋め込むための手順を示す。

【0033】図12は、アクセス制御情報 (透かし情報) のビット系列の一例を示す図である。ここでは、1201がビット"0"、1202がビット"1"を示す。

【0034】図13及び図14は、文書画像に、この文書画像をアクセスするためのアクセス制御情報(透かし情報)を埋め込む処理を示すフローチャートである。以下、このフローチャートを参照して動作を説明する。

【0035】まずステップS1で、参照パターン特徴量空間と基準ベクトルのマハラノビス距離(マハラノビス 距離: MD1)を算出する。但し、次の式(1)による。

[0036]

 $D2=(x-\mu)'Σ^{-1}(x-\mu) ···式(1)$ 

ここで、xは基準ベクトル、 $\mu$ は参照パターン特徴量空%50%間の平均ベクトル、 $\Sigma^{-1}$ は、参照パターン特徴量空間の

7

分散共分散行列の逆行列、そして、D2は基準ベクトル xと参照パターン特徴量空間の平均ベクトルμのマハラ ノビス距離 (MD1) である。尚、基準ベクトルと参照 パターンが予め決定されている場合は、このマハラノビ ス距離は、予め計算されてメモリ等に記憶されていても よい。

【0037】図15は、参照パターン特徴量ベクトル空間と基本ベクトルとのマハラノビス距離(MD1)を求め、透かし情報を入れる対象である文書画像(観測パターン)の特徴量ベクトルを、透かし情報に対応して変更 10する例を示す概念図である。この図15において、1500は基準ベクトルを示し、1501は参照パターン特徴量ベクトルを示している。また1502は観測パターンの特徴量ベクトルを示している。

【0038】次にステップS2に進み、図1の2値化K 画像データ104に相当する文書画像を読み込む。次にステップS3に進み、図16に示すように、ステップS2で読み込んだ文書画像を分割する。図16において、1601は、M×N画素のブロックを示し、1602が、各ブロックの行番号インデックス、1603が、各20ブロックの列番号インデックスを示す。同図において、インデックス番号はm×n行列となる。このインデックス行列に基づいて、m×n次元の各ブロックに対応するインデックス・ベクトルを発生させる。この際、インデックス・ベクトルを発生させる。この際、インデックス・ベクトルの要素番号が、各ブロック1601のインデックス番号となる。

【0039】次にステップS4に進み、予め決まっている、或いは、ユーザにより入力されたキー情報に基づき、"1"から"m×n"までの間の乱数を発生させる。この際、発生した乱数は、ステップS3で生成した 30インデックス・ベクトルの要素番号に対応している。つまり、各乱数値が各ブロックのインデックス番号に対応することになる。

【0040】そしてステップS5で、例えば図12に示すアクセス制御情報のビット系列(8ビットデータ)と、各ブロックのインデックス番号とを対応付ける。この際、対応付けがビット系列の最後(図12の例では8ビット目)までくると、次のブロックとの対応付けは、そのビット系列の先頭(1ビット目)から始まる。こうして、全てのブロックにビット系列の各ビットを割当て40るまで、このビット系列が繰り返し割当てられる。

【0041】図17は、透かし情報であるビット系列1701、ステップS4で発生された乱数列1702及び各ブロックのインデックス番号の対応例を示す図である。

【0042】図17において、1701はビット系列を、1702はそれに対応する乱数列を示し、ビット系列1701のビット数と、各ブロックのインデックス番号でもある乱数(R1~Rm)1702の個数は、ともに(m×n)個である。また図17において、乱数R1は

インデックス番号 (I, J) = (1、1)のブロックに 対応し、乱数R2はインデックス番号 (I, J) = (1、2)のブロックに対応し、以下同様にして、最後 の乱数Rmはインデックス番号 (I, J) = (m、n) のブロックに対応している。

【0043】次にステップS6に進み、乱数列1702のX=1番目(図17では乱数R1)に対応するブロック(I,J=(1,1))のインデックス番号、及びそれに対応するビット系列1701のビットの値(図17の例では"0")を取得する。そしてステップS8に進み、その取得したインデックス番号に対応するM×Nの文書画像のブロックを取得する。次にステップS9に進み、その取得したM×Nの文書画像を観測画像とした時の観測パターン特徴量空間と基準ベクトルのマハラノビス距離(MD2)を算出する。これは次の式(2)に基づいて求められる。

【0044】D2= (x-μ) "Σ-1 (x-μ) ここで、xは基準ベクトル、μは観測パターン特徴量空 間の平均ベクトル、Σ-1は、観測パターン特徴量空間の 分散共分散行列の逆行列、そして、D2は基準ベクトル xと観測パターン特徴量空間の平均ベクトルμのマハラ ノビス距離 (MD2) である。

【0045】そしてステップS10に進み、そのブロックに対応するビット系列1701のビットが"0"かどうかを判断し、"0"であればステップS11に進み、MD1>MD2+defMD

となるように観測パターンの特徴量空間全体を移動させる。

【0046】またステップS10で、そのブロックに対 の 応するビット系列1701のビットが"1"であればス テップS13に進み、

MD1 < MD2 + defMD

となるように観測パターンの特徴量空間全体を移動させる。但し、defMDは、予め設定した値とする。

【0047】これは図15において、観測パターンの特徴量ベクトルが1502で示されており、1503はステップS11或はステップS13で移動された観測パターンの特徴量ベクトルを示している。この移動に際しては、観測パターン特徴量空間の全ての特徴量ベクトルの各要素の値が増える方向に移動を行い、各要素の値が減る方向には移動しないものとする。

【0048】そしてステップS12に進み、その観測パターン特徴量空間を移動した後の観測パターンの特徴量空間を基に、観測画像データを再構成する。そしてステップS6で、乱数列が存在しなくなるまで、即ち、m×n番目の乱数に対する処理が終了するまで行う。

【0049】このようにして得られた2値K画像データは、図1の2値K画像データ104としてアリンタ・エンジンに出力されて印刷される。

50 【0050】図18は、本実施の形態1に係る画像処理

装置のハードウェア構成を示すブロック図である。

【0051】図において、110は画像データを入力す る入力部で、例えばスキャナであったり、或はCD-R OM等の記憶媒体を装着して、そこに記憶されてい画像 データを入力するメモリデバイス等を備えている。な お、画像データは後述する外部記憶装置115からロー ドされても、或は回線インターフェース (I/F) 11 7を介して、他のネットワークなどから入力されてもよ い。111はこの装置全体の動作を制御するCPUで、 このCPU111により実行されるプログラム (例えば 10 図13、図14のフローチャートで示す) はメモリ11 2に記憶されている。メモリ112は、上述の各種処理 において画像データを一時的に格納したり、或は入力/ 発生された乱数、各ベクトル情報、インデックス情報等 を記憶するとともに、CPU111の処理時に各種デー タを記憶するためのワークエリアとしても使用される。 113は、例えばキーボードやマウス等のポインティン グデバイスを備える入力部で、オペレータにより操作さ れて、前述の乱数の発生を指示したり、或は各種制御情 報などを入力するのに使用される。

【0052】114はディスプレイ (表示部) で、例え ばCRTや液晶等を有している。115は外部記憶装置 で、ハードディスクやMO等の記憶媒体を備え、各種画 像データやプログラム等を記憶している。116はプリ ンタで、この実施の形態1では前述したようにLBPで あるが、本発明はこれに限定されるものでなく、例えば インクジェット法によるプリンタ等であってもよい。1 17は回線インターフェース部で、通信回線を介して他 の機器或はネットワークとの間での通信制御を行ってい る.

【0053】次に、上記説明したようにして電子透かし が埋め込まれた画像からアクセス制御情報(透かし情 報)を抽出する場合について説明する。

【0054】図19及び図20は、印刷された画像から

アクセス制御情報を取り出す処理を示すフローチャート で、この処理を実行するプログラムはメモリ112に記 憶されており、CPU111の制御の基に実行される。 【0055】まずステップS21で、前述の図13のス テップS1と同様にして、参照パターン特徴量空間と基 準ベクトルのマハラノビス距離(MD1)を算出する。 次にステップS22に進み、画像入力部110のスキャ ナを使用して、その印刷された画像をグレースケールモ ード (8ビット/画素)で読み取る。次にステップS2 3に進み、その読み取った画像の輪郭部を抽出し、例え ば図4で示したように、輪郭部分を1画素に細線化した 輪郭画像を生成する。そしてステップS24に進み、そ の輪郭画像を、アクセス制御情報を付加した時のサイズ に変換する。この変換した後の輪郭画像に対して以下の 処理を行う。尚、図19及び図20におけるステップS 25~S30の処理は、前述の図13及び図14のステ 50 る。

ップS3、S4、S6~S9の処理と基本的に同じであ る。但し、ステップS28では、乱数列のX番目に対応 するブロックのインデックス番号だけを取り出す点が、 前述のステップS7とは異なっている。

12

【0056】即ち、まずステップS25で、前述の図1 6に示すように、輪郭画像をM×Nのブロックで分割 し、各ブロックの行番号インデックス、列番号インデッ クスからm×nのインデックス行列を生成する。そし て、このインデックス行列からm×n次元のインデック ス・ベクトルを発生する。ここで、インデックス・ベク トルの要素番号が各ブロックのインデックス番号とな

【0057】次にステップS26に進み、予め決まって いる、或いは、ユーザにより入力されたキー情報に基づ き、1~m×nの乱数を発生させる。この際、発生した 乱数は、ステップS25で生成したインデックス・ベク トルの要素番号に対応する。つまり、各乱数値が各プロ ックのインデックス番号になる。ステップS27で、乱 数列が存在するか、即ち、全ブロックに対する処理が終 了したかを調べ、終了していない時はステップS28に 進み、乱数列のX=1番目(R1)に対応するブロック のインデックス番号を取得する。そしてステップS29 では、その取得したブロックのインデックス番号に対応 するM×Nの輪郭画像を取得し、ステップS30では、 その取得したM×Nの文書画像を観測画像とした時の観 測パターン特徴量空間と、基準ベクトルのマハラノビス 距離(MD2)を算出する。これは上述の式(2)によ り求めることができる。

【0058】次にステップS31に進み、こうして得ら 30 れたマハラノビス距離 (MD1) とマハラノビス距離 (MD2)の類似度(g)を算出する。この際の類似度 (g)は、次の式による。

[0059]g = MD1 - MD2

ステップS32では、この算出された類似度(g)と所 定値(defMD)とを比較し、g>defMDならばステッ プS33に進み、埋め込まれているビットが"O"であ ると判定する。またステップS32で、g>deMDZで なければステップS34に進み、埋め込まれてるビット が"1"であると判定する。こうしてステップS33或 40 はS34を実行した後ステップS27に戻り、同様の処 理をm×n番目の乱数に対して行うまで繰り返しステッ プS28~S34の処理を実行する。このようにして抽 出されたビット系列を基に多数決判定を行い、埋め込み 時のビット長を再現する.

【0060】以上説明したように本実施の形態1によれ ば、画像を劣化させることなく、所望の制御情報を埋め 込むことができる。

【0061】また、画像に埋め込まれた制御情報を高精 度に読み取って検出することができるという効果があ

【0062】[実施の形態2]次に本発明の実施の形態 2について説明する。 尚、 この実施の形態 2において も、ハードウェア構成は前述の実施の形態1に係る構成 (図18)と同様であるので、それらの説明を省略す る.

【0063】ここではまず、前述の図3のM×N画素か らなる2値の観測画像を基に、図4のように、その2値 の観測画像の輪郭部を抽出して1画素に細線化した輪郭 画像を得る。前述の図5は、注目画案を3×3ブロック の中心に置いた場合の注目画素の特徴量を抽出するため 10 ベクトルを示す。また、この次元数は8次元とする。 の方向指数指標を示す図で、図25は、この図5の注目 画素の方向指数の特徴量t1、t2、t3、t4、t5、t 6、t7、t8に対する値を示す。ここで前述の図6とは 逆に、値"0"はその方向に画素があることを示し、値 "1"はその方向に画素がないことを示している。

【0064】図26は、図25に示した図5の注目画素 Pijの方向指数特徴量をベクトル化したものである。こ こで、Hijは、注目画素Pijの方向指数特徴量のベクト ルを示す。また、次元数は8次元とする。

【0065】この場合の観測パターン特徴量空間は、前 述の図3で得られた2値の観測画像において、図4で得 られた輪郭画像における各輪郭を図5の注目画素とした 場合の方向指数特徴量ベクトルの集合である。また、観 測パターン特徴量空間の次元数は8次元とする。また基 準ベクトルは、前述の図8に示したパターンの方向指数 特徴量とする。

【0066】図27は、図8の方向指数特徴量ベクトル DISTである。また、次元数は8次元とする。ここで も "0" は、その方向に画素があることを示し、 "1" はその方向に画素がないことを示している。

【0067】この場合の参照パターン特徴量空間は、S ×T画素の参照画像(実施の形態1の図10)の輪郭画 像(同じく前述の図11)における各画素毎の方向指数 特徴量ベクトルの集合である。また、参照パターン特徴 量空間の次元数は8次元とする。

【0068】この実施の形態2においても、アクセス制 御情報 (透かし情報) は前述の実施の形態1に係る図1 2のデータと同一とする。

【0069】次に、本実施の形態2に係るアクセス制御 情報の検出に係わる観測パターン特徴量空間、基準ベク トル、参照パターン特徴量空間について説明する。

【0070】図28は、前述の図2の201の一部に相 当するM×N画素の多値グレースケールである観測画像 例を示す。 図29は、図28の多値グレースケールであ る観測画像の輪郭部を抽出して1画素に細線化した輪郭 画像である。また図30は、注目画素を3×3ブロック の中心に置いた場合の注目画素の特徴量を抽出するため の方向指数指標を示す図である。この図では、注目画素 のt1方向の画素値が"128"、t2方向の画素値が

画素値が"0"、 t4方向の画素値が"255"、 t5方 向の画素値が "240" 、t6方向の画素値が "25 5"、そしても7方向の画素値が "255" となってい る。

14

【0071】図31は、図30の注目画素の方向指数の 特徴量t1、t2、t3、t4、t5、t6、t7、t8に対す る画素値を示し、図32は、図31に示した、図5の注 目画素Pijの方向指数特徴量をベクトル化したものであ る。ここで、Hijは、注目画素Pijの方向指数特徴量の

【0072】観測パターン特徴量空間は、図28で得ら れた多値グレースケールである観測画像において、図2 9で得られた輪郭画像における各輪郭点を図30の注目 画素とした場合の方向指数特徴量ベクトルの集合であ る。また、観測パターン特徴量空間の次元数は8次元と

【0073】基準ベクトルは、図33に示したパターン の方向指数特徴量とする。

【0074】図34は、図33の方向指数特徴量ベクト ルDISTである。また、この次元数は8次元とする。 【0075】参照パターン特徴量空間は、S×T画素の 参照画像(前述の図10参照)の輪郭画像(同じく図1 1参照) における各画素毎の方向指数特徴量ベクトルの 集合である。また、参照パターン特徴量空間の次元数は 8次元とする。

【0076】次に、本発明の実施の形態2に係る、文書 画像にアクセス制御情報を埋め込むための処理手順を説

【0077】図35及び図36は、本発明の実施の形態 30 2に係る、文書画像にアクセス制御情報を埋め込むため の処理を示すフローチャートである。

【0078】まずステップS41で、参照パターン特徴 量空間と基準ベクトルのマハラノビス距離 (Mahalanobi s's generalized distance: MD1)を算出する。但 し、この距離は次の式により求められる。

[0079] D2=  $(x-\mu)' \Sigma^{-1} (x-\mu)$ ここで、xは基準ベクトル、μは参照パターン特徴量空 間の平均ベクトル、Σ-1は、参照パターン特徴量空間の 分散共分散行列の逆行列、そして、D2は基準ベクトル xと参照パターン特徴量空間の平均ベクトルμのマハラ ノビス距離 (MD1) である。

【0080】次にステップS42に進み、図1の104 に相当する2値の文書画像を読み込む、次にステップS 43に進み、前述の図16に示すように、2値の文書画 像をM×Nのブロックで分割する。図16では、160 1がM×Nのブロックを示し、1602が行番号インデ ックス、1603が列番号インデックスを示す。同図に おいて、インデックス番号はm×n行列となる。このイ ンデックス行列からm×n次元のインデックスベクトル "150"、t3方向の画素値が"198"、t8方向の 50 を発生させる。この際、インデックスベクトルの要素番 号が各ブロックのインデックス番号となる。

【0081】次にステップS44に進み、予め決まって いる、或いは、ユーザが入力したキー情報に基づいて、 "1"から "m×n" までの乱数を発生させる。この 際、発生した乱数は、ステップS43で生成したインデ ックスベクトルの要素番号に対応する。つまり、各乱数 値が各ブロックのインデックス番号になる。

【0082】そしてステップS45に進み、アクセス制 御情報(透かし情報)のビット系列(図12)と、ブロ ックのインデックス番号とを対応付ける。この際、対応 10 付けがビット系列の最後までくると、次の対応付けは、 ビット系列の先頭からとなる。ステップS46では、乱 数列が存在するかどうかを調べ、存在する時はステップ S47に進む。

【0083】前述の図17は、ビット系列、乱数列、ブ ロックのインデックス番号の対応例を示す図である。ビ ット系列1701の個数と、乱数列でありブロックのイ ンデックス番号でもある1702の個数は共に (m×n 個) である。

に対応するブロックのインデックス番号及びビットを取 得する。そしてステップS48に進み、その取得したブ ロックのインデックス番号に対応するM×Nの2値の文 書画像を取得し、その取得したM×Nの2値の文書画像 を観測画像とした時の観測パターン特徴量空間と、基準 ベクトルのマハラノビス距離(MD2)を算出する(ス テップS49)。

【0085】これは次の式により求められる。

[0086] D2=  $(x-\mu)' \Sigma^{-1} (x-\mu)$ 

間の平均ベクトル、Σ-1は、観測パターン特徴量空間の 分散共分散行列の逆行列、そして、D2は基準ベクトル xと観測パターン特徴量空間の平均ベクトルμのマハラ ノビス距離 (MD2)である。

【0087】次にステップS50に進み、アクセス制御 情報のビットが"O"ならばステップS51に進み、M D1>MD2+defMDとなるように観測パターンの特 徴量空間全体を移動させる。一方、アクセス制御情報の ビットが"1"ならばステップS52に進み、MD1く MD2+defMDとなるように観測パターンの特徴量空 間全体を移動させる。但し、ここで「defMD」は、予 め設定した値とする。

【0088】尚、これらステップS51, S52におけ る空間全体の移動は、観測パターン特徴量空間の全ての 特徴量ベクトルの各要素の値が増える方向に行い、各要 素の値が減る方向には行わない。そしてステップS53 に進み、移動後の観測パターンの特徴量空間を基に観測 画像を再構成する。同様の処理を、乱数列のm×n番目 まで行う。

16 は、図1の104で示すプリンタエンジンに渡されて記 録紙に記録される。

【0090】以上のようにして、透かし情報が埋め込ま れて印刷された印刷物からアクセス制御情報(透かし情 報)を抽出するための処理を以下に説明する。

【0091】図37は、埋め込まれている透かし情報を 抽出する処理を示すフローチャートである。

【0092】まずステップS61で、参照パターン特徴 量空間と基準ベクトルのマハラノビス距離(MD1)を 算出する。これは次式により求められる。

[0093] D2=  $(x-\mu)$ ,  $\Sigma^{-1}(x-\mu)$ ここで、xは基準ベクトル、μは参照パターン特徴量空 間の平均ベクトル、Σ-1は、参照パターン特徴量空間の 分散共分散行列の逆行列、そして、D2は基準ベクトル xと参照パターン特徴量空間の平均ベクトルμのマハラ ノビス距離(MD1)である。

【0094】そしてステップS62に進み、印刷物をグ レースケールモード各8ピットでスキャナで読み取る。 次にステップS63に進み、その読み取った多値グレー 【0084】ステップS47では、乱数列のX=1番目 20 スケール画像を、アクセス制御情報を付加した時のサイ ズに変換する。そしてステップS64に進み、輪郭部を 抽出し、1 画素に細線化した輪郭画像を生成する。

【0095】ここではまず図16に示すように、 ステッ プS63で、サイズ変換を行った後の多値グレースケー ル画像をM×Nのブロックで分割する。ここでは、M× Nブロック1601、行番号インデックス1602、列 番号インデックス1603が示されており、インデック ス番号はm×n行列となる。このインデックス行列から m×n次元のインデックス・ベクトルを発生させる(ス ここで、xは基準ベクトル、μは観測パターン特徴量空 30 テップS65)。この際、インデックスベクトルの要素 番号が、各ブロックのインデックス番号となる。

> 【0096】次にステップS66に進み、予め決まって いる、或いは、ユーザが入力したキー情報に基づいて "1"から "m×n" までの乱数を発生させる。 この 際、発生した乱数は、ステップS65で生成したインデ ックスベクトルの要素番号に対応する。つまり、各乱数 値が各ブロックのインデックス番号になる。

【0097】更にステップS68では、乱数列のX=1 番目に対応するブロックのインデックス番号及を取得す る。そしてステップS69に進み、その取得したブロッ クのインデックス番号に対応するM×Nの輪郭画像を取 得し、その取得したM×Nの輪郭画像と対応するサイズ 変換後の多値グレースケールより、観測パターン特徴量 空間と基準ベクトルのマハラノビス距離 (MD2) を算 出する(ステップS70)。これは、次の式により求め られる。

 $[0098] D2 = (x-\mu)' \Sigma^{-1} (x-\mu)$ ここで、xは基準ベクトル、μは観測パターン特徴量空 間の平均ベクトル、Σ⁻¹は、観測パターン特徴量空間の 【0089】このようにして得られた2値K画像データ 50 分散共分散行列の逆行列、そして、D2は基準ベクトルx と観測パターン特徴量空間の平均ベクトルμのマハラノ ビス距離 (MD2)である。

【0099】こうして得られたマハラノビス距離(MD1)と、マハラノビス距離(MD2)の類似度を算出する(2510)。この際の類似度は、次の式による。

【0100】g=MD1-MD2 ここで、gを類似度とする。

【0101】こうしてステップS71に進み、この類似度gと「defMD」とを比べて、もし、g>defMDならばステップS73に進み、埋め込まれているビットが

"0"であると判定する。一方、そうでなければステップS74に進み、その埋め込まれてるビットが"1"であると判定する。尚、この「defMD」は、予め設定した値とする。同様の処理を、ステップS67で、最終の乱数列、即ち、乱数列のm×n番目を検出するまで行う。このようにして抽出されたビット系列を多数決判定を行い、埋め込み時のビット長とする。

【0102】なお本発明は、複数の機器(例えばホストコンピュータ、インターフェース機器、リーダ、プリンタなど)から構成されるシステムに適用しても、一つの20機器からなる装置(例えば、複写機、ファクシミリ装置など)に適用してもよい。

【0103】また本発明の目的は、前述した実施形態の 機能を実現するソフトウェアのプログラムコードを記録 した記憶媒体(または記録媒体)を、システムあるいは 装置に供給し、そのシステムあるいは装置のコンピュー タ (またはCPUやMPU) が記憶媒体に格納されたプログラ ムコードを読み出し実行することによっても達成され る。この場合、記憶媒体から読み出されたプログラムコ ード自体が前述した実施形態の機能を実現することにな 30 り、そのプログラムコードを記憶した記憶媒体は本発明 を構成することになる。また、コンピュータが読み出し たプログラムコードを実行することにより、前述した実 施形態の機能が実現されるだけでなく、そのプログラム コードの指示に基づき、コンピュータ上で稼働している オペレーティングシステム(OS)などが実際の処理の一部 または全部を行い、その処理によって前述した実施形態 の機能が実現される場合も含まれる。

【0104】さらに、記憶媒体から読み出されたプログラムコードが、コンピュータに挿入された機能拡張カー 40ドやコンピュータに接続された機能拡張ユニットに備わるメモリに書込まれた後、そのプログラムコードの指示に基づき、その機能拡張カードや機能拡張ユニットに備わるCPUなどが実際の処理の一部または全部を行い、その処理によって前述した実施形態の機能が実現される場合も含まれる。

## [0105]

【発明の効果】以上説明したように本発明によれば、画像の劣化を無くして、その画像にアクセス制御情報を埋め込むことができる。

【0106】又本発明によれば、埋め込まれているアクセス制御情報を高精度に読み取ることができるという効果がある。

18

【図面の簡単な説明】

【図1】本実施の形態における文書画像データの変換の流れを説明する図である。

【図2】スキャナのアクセス制御情報の読み取りに係わる画像データの流れを示す図である。

【図3】M×N画素の観測画像(文書画像)の一例を示10 す図である。

【図4】図3の観測画像の輪郭部を1画素で示す輪郭画像の一例を示す図である。

【図5】注目画素の方向指数特徴量を説明する図である。

【図6】図5の注目画素の方向指数特徴量の変量とその 値を示す図である。

【図7】図6の方向指数特徴量の変量を方向指数特徴量ベクトルで示す図である。

【図8】基準ベクトルの画像の一例を示す図である。

0 【図9】図8の基準ベクトルの方向指数特徴量を説明する図である。

【図10】S×T画素で構成される参照画像の一例を示す図である。

【図11】図10の参照画像の輪郭部を1画素に細線化した輪郭画像の例を示す図である。

【図12】アクセス制御情報のビット系列の一例を示す 図である。

【図13】本実施の形態1に係る画像処理装置における、文書画像にアクセス制御情報を埋め込む処理を示すフローチャートである。

【図14】本実施の形態1に係る画像処理装置における、文書画像にアクセス制御情報を埋め込む処理を示すフローチャートである。

【図15】参照パターン特徴量ベクトル空間と基準ベクトルとのマハラノビス距離(MD1)と、観測パターン特徴量ベクトルと基準ベクトルとのマハラノビス距離(MD2)説明する概念図である。

【図16】文書画像をブロックに分割した例を示す図で ある。

0 【図17】図16で分割した各ブロックにアクセス制御情報ビット系列、乱数系列を割り当てた例を説明する図である。

【図18】本実施の形態に係る画像処理装置のハードウェア構成を示すブロック図である。

【図19】実施の形態1に係る、印刷された画像から、 その画像埋め込まれているアクセス制御情報を抽出する 処理を示すフローチャートである。

【図20】実施の形態1に係る、印刷された画像から、 その画像埋め込まれているアクセス制御情報を抽出する 50 処理を示すフローチャートである。 19

【図21】単語間のスペースの量を制御して制御情報を 埋め込む例を説明する図である。

【図22】文字の回転前の状態を示す図である。

【図23】文字を回転して制御情報を埋め込む処理を説 明する図である。

【図24】文字を拡大・縮小して制御情報を埋め込む例 を説明する図である。

【図25】本発明の実施の形態2に係る、図5の注目画 案の方向指数特徴量の変量とその値を示す図である。

【図26】図25の方向指数特徴量の変量を方向指数特 10 **敬量ベクトルで示す図である。** 

【図27】本発明の実施の形態2に係る、図8の基準へ クトルの方向指数特徴量を説明する図である。

【図28】本発明の実施の形態2に係る、M×N画素の 観測画像(文書画像)の一例を示す図である。

【図29】図28の観測画像の輪郭部を1画素で示す輪 郭画像の一例を示す図である。

【図30】注目画素の方向指数特徴量を説明する図であ る.

【図31】本実施の形態2に係る注目画素の方向指数特 20

徴量の変量とその値を示す図である。

【図32】図31の方向指数特徴量の変量を方向指数特 徴量ベクトルで示す図である。

20

【図33】実施の形態2に係る、基準ベクトルの画像の 一例を示す図である。

【図34】実施の形態2に係る、図33の基準ベクトル の方向指数特徴量を説明する図である。

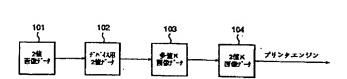
【図35】本実施の形態2に係る画像処理装置におけ る、文書画像にアクセス制御情報を埋め込む処理を示す フローチャートである。

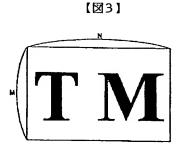
【図36】本実施の形態2に係る画像処理装置におけ る、文書画像にアクセス制御情報を埋め込む処理を示す フローチャートである。

【図37】本実施の形態2に係る、印刷された画像か ら、その画像埋め込まれているアクセス制御情報を抽出 する処理を示すフローチャートである。

【図38】本実施の形態2に係る、印刷された画像か ら、その画像埋め込まれているアクセス制御情報を抽出 する処理を示すフローチャートである。

【図1】



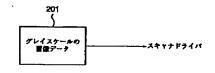


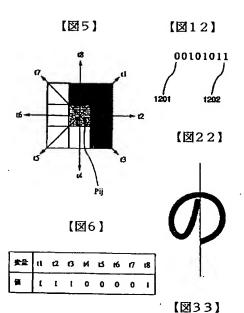
【図4】

【図7】

Hij = (1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1)

# 【図2】

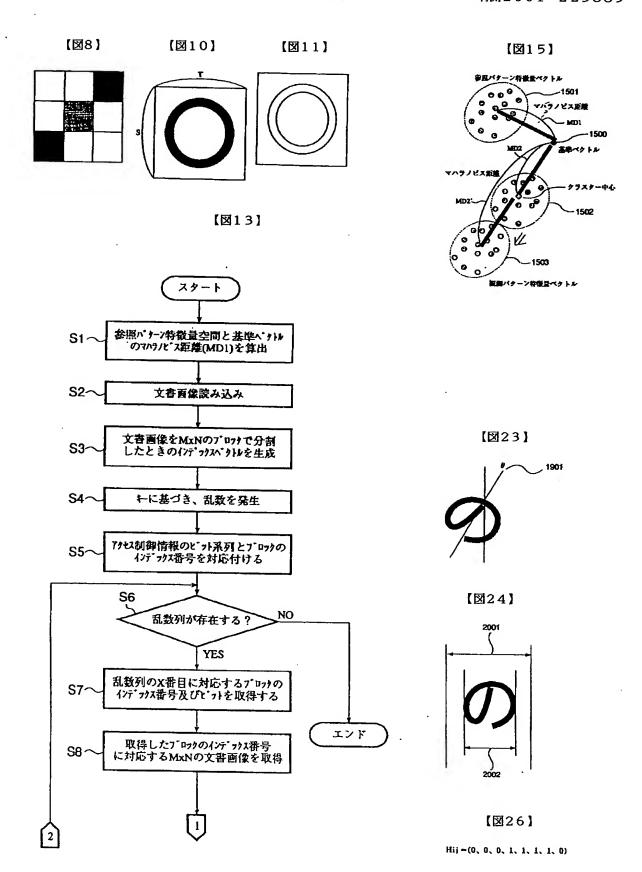




【図9】

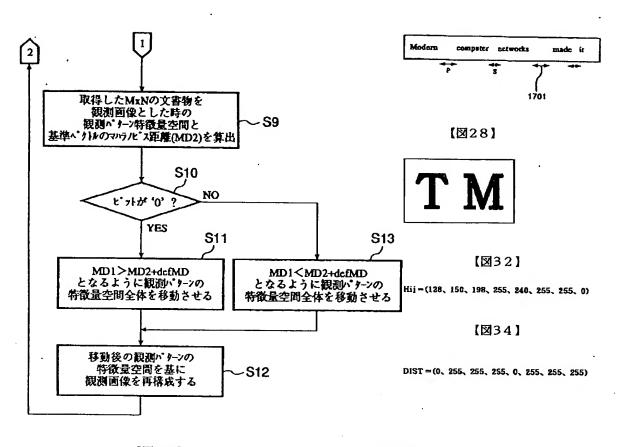
DIST = (1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0)





【図14】

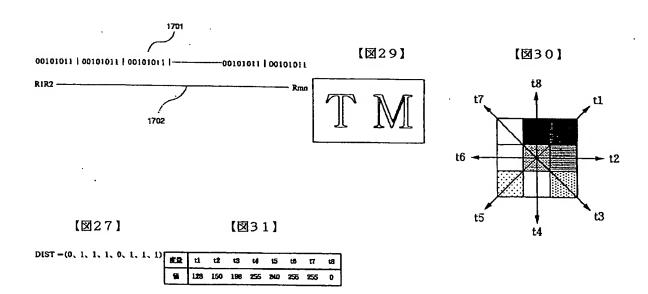
【図21】



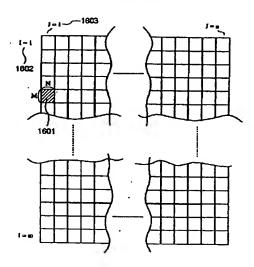
【図17】

【図25】

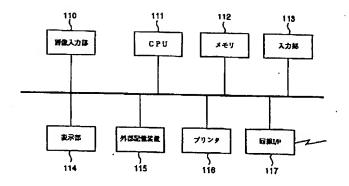
在章	2	12	t3	t4	15	t6	17	t#9
催	٥	0	0	1	1	1	1	0



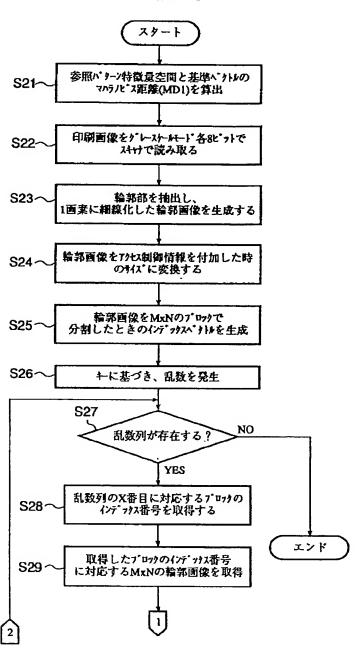
【図16】



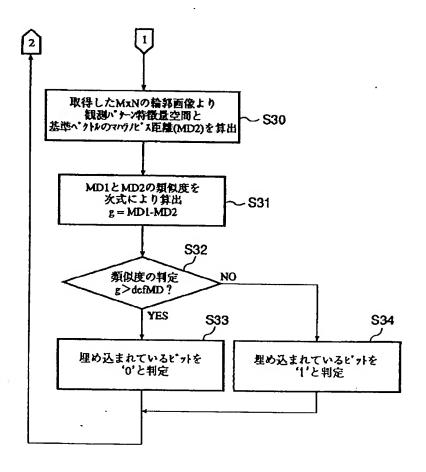
【図18】



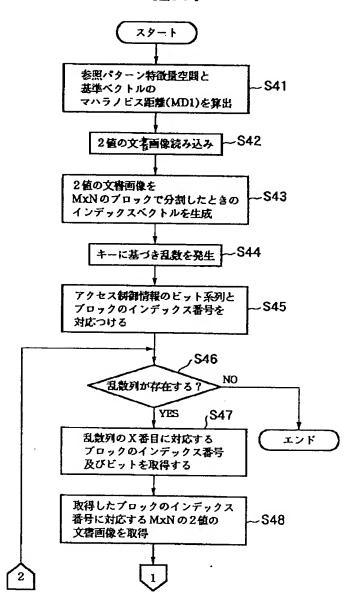
【図19】



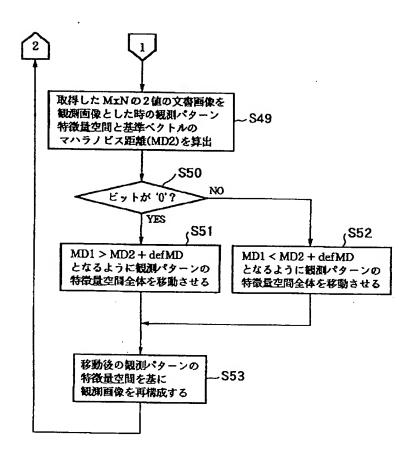
【図20】



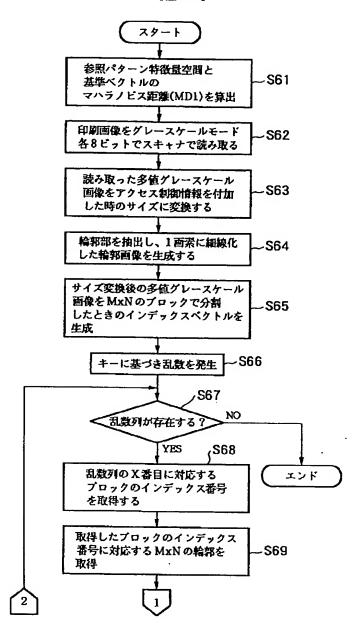
【図35】



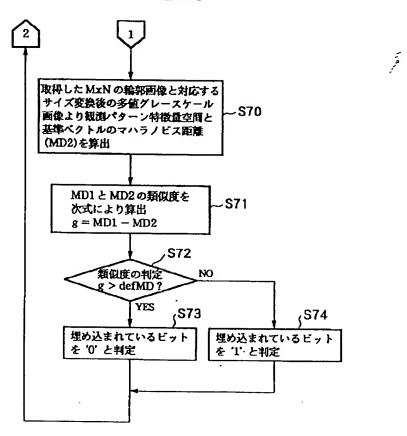
【図36】







# 【図38】



### フロントページの続き

Fターム(参考) 5B057 AA11 BA02 CA02 CA06 CA12

CA17 CB02 CB06 CB12 CB17

CB19 CE08 CE09 CG07 CH08

CH18 DA17 DB02 DB05 DB08

DC01 DC16 DC32

5C076 AA02 AA14 AA17 AA31 BA02

BA06

· 5C077 LL14 MP04 MP07 PP23 PP46

PP49 PP66 PP68 PQ12 PQ20